

# MX-4 半导体检测显微镜



### 产品用途

**MX-4 半导体检测显微镜**采用无限远色差校正光学系统,具有大视野、成像质量高、功能扩展性强(明场/斜照明/偏振光/DIC 观察)、大平台等特点;同时配有长工作距半复消色差物镜和可快速和慢速移动的大行程载物台,尤其适合半导体掩模板、液晶基板或其它平面显示器及各种工业器件的检验。

### 产品特点

- ➤ 安全、稳重的机架结构设计:工业检测级显微镜镜体,低重心、高刚性、高稳定性金属机架,保证了系统的抗震能力与成像稳定性。其前置低手位粗微调同轴调焦机构,内置 100-240V 宽电压变压器,可适应不同地区的电网电压。底座内部设计有风循环散热系统,长时间使用也不会使机架过热
- ▶ **反射照明器**: 单颗大功率 5W 白色 LED 照明,带斜照明机构。切换至斜照明时,可以使物体表面不同 材质部分呈现立体图案,增加观察的对比度与视觉效果
- ▶ **高性能物镜转换器**: MX4R 转换器采用精密轴承设计,转动手感轻巧舒适,重复定位精度高,物镜转换 后的同心度也得到较好的控制,根据需求可配置不同孔位的转换器

## 产品规格

规格参数				
光路系统	<del>1</del>	•		
观察头	铰链三通观察筒,30°倾斜,360°旋转;瞳距范围:50mm~75mm			•
	正像, 视度调节±5°; 两档分光比 R:T=100:0 或 50:50			•
目镜	高眼点力	•		
无限远长工作	倍率	数值孔径(N. A.)	工作距离(W.D.)	
距平场消色差	5×-DIC	0. 15	10.80mm	•
金相物镜	10×-DIC	0.3	12.20mm	



	20×-DIC	0. 45	4.00mm	
无限远长工作	50×	0. 55	7. 90mm	
距平场半复消 金相物镜	100×(选配)	0.8	2.10mm	0
放大倍数	50×-500×			•
物镜转轮(DIC)	内定	•		
载物台	6 英寸三层机械移动平台,低手位 X、Y 方向同轴调节			•
	平台面积 445mmX240m			
	照明移动范围:100mm			
	玻璃载物台板。(透/反射用)			
调焦机构	粗、微动同轴低手位调焦机构、带锁紧和限位装置			•
	微动构			
DIC 微分干涉	DIC	0		
简易偏光装置	φ 30 起偏镜插板(反	•		
反射照明系统	柯拉照明系统,带视场光阑与孔径光阑,中心可调			•
	带斜射照明装置			•
	100-240V 宽电压, 单颗大功率 5W LED, 暖色			•
透射照明系统	内置 5W 暖色 LED 透射光照明系统,上下光可独立控制			•
数码成像系统	高质量 0.5X CCD 适配镜			•
	Puda 630 万 USB 🧵			
	6.3M/IMX178(C),1/1			
	1024 高性能芯片组/1			
	原处理/			
	To	ToupView 专业的图像软件		
可升级配件	目镜: 10×(分划)			0

注解: ●为标配、○为可升级配件

# 特别声明:

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考,请以销售实物为准。
  - 以上内容如有变动, 恕不另行通知。